## 形位公差与技术测量



作者: 杨恩烈, 余锴坚编著

出版社:沈阳:辽宁科学技术出版社

出版日期: 1981.11

总页数: 283

说明: 登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/10912884.html) 查找全本阅读方式

形位公差与技术测量 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10912884.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10912884.html

书名: 形位公差与技术测量